

3

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-010107  
(43)Date of publication of application : 16.01.2001

(51)Int.Cl. B41J 2/44  
G02B 26/10

(21)Application number : 11-179811  
(22)Date of filing : 25.06.1999

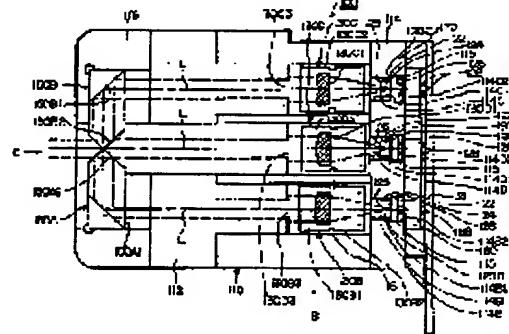
(71)Applicant : ASAHI OPTICAL CO LTD  
(72)Inventor : HAMA YOSHIHIRO  
SUZUKI YASUSHI  
MIKAJIRI SUSUMU

**(54) MULTI-BEAM LIGHT SOURCE SCANNING DEVICE**

**(57)Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a multi-beam light source scanning device that can prevent dislocation of a light beam in the scanning direction due to temperature differences among semiconductor lasers.

**SOLUTION:** A semiconductor laser holding section 170 is made up of a vertical wall 114, and housing hole portions 114B to 114D provided in the vertical wall 114. Semiconductor lasers 120A to 120D are inserted into the housing hole portions 114B to 114D with upper portions 125 forward, and fixed with housings 124 abutted against stepped portions 115 by a mounting plate 160 and a substrate portion 121, namely with the housings 124 and the stepped portions 115 closely contacted. The semiconductor laser holding section 170 holds the cases 122 in a manner that makes the cases 122 of the semiconductor lasers 120B to 120D mutually conduct heat through the semiconductor laser holding section 170.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 07.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-10107

(P2001-10107A)

(43)公開日 平成13年1月16日(2001.1.16)

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

B 41 J 2/44  
G 02 B 26/10

識別記号

F I

B 41 J 3/00  
G 02 B 26/10

テマコート\*(参考)  
D 2 C 3 6 2  
B 2 H 0 4 5

審査請求 未請求 請求項の数10 ○ L (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平11-179811

(22)出願日

平成11年6月25日(1999.6.25)

(71)出願人

旭光学工業株式会社

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

(72)発明者

浜 善博

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工業株式会社内

(72)発明者

鈴木 康史

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工業株式会社内

(74)代理人

100089875

弁理士 野田 茂

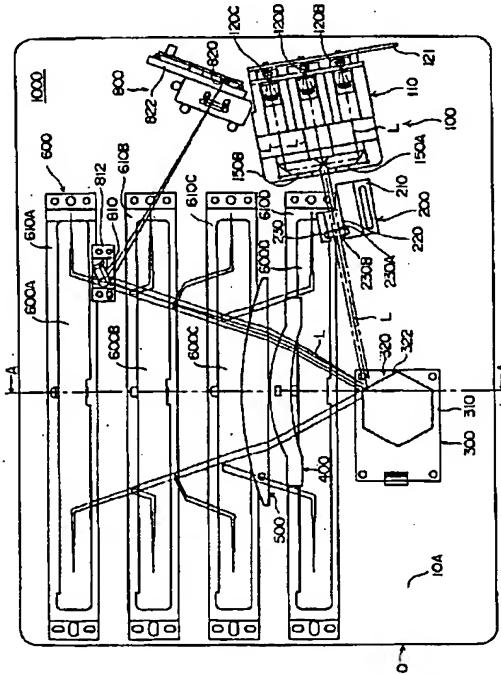
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 マルチビーム光源走査装置

(57)【要約】

【課題】 各半導体レーザの温度差に起因する光ビームの走査方向の位置ずれを防止することができるマルチビーム光源走査装置を提供する。

【解決手段】 半導体レーザ保持部170は、縦壁114と、この縦壁114に設けられた収容孔部114A乃至114Dによって構成される。各半導体レーザ120A乃至120Dは、上部125を前方にして各収容孔部114A乃至114Dに挿入され、取付板160と基板部121によってハウジング124が段部115に当て付けられた状態で、すなわちハウジング124と段部115が密接した状態で固定されるようになっている。半導体レーザ保持部170は、各半導体レーザ120A乃至120Dのケース122が半導体レーザ保持部170を介して相互に熱伝導される状態で各ケース122を保持している。



ビームの波長が小さくなる特性を有している。したがって、複数の半導体レーザが異なるタイミングで異なる時間駆動されると、各半導体レーザの発光体は互いに温度差が生じるため、各半導体レーザから出射される光ビームの波長は互いに異なってくる。一方、これら各ビームを入射する  $f\theta$  レンズは、同一波長の光ビームに対しては同一の光学的特性を有しているが、波長が変化すれば、その光学的特性が変化する。したがって、波長が異なる光ビームが  $f\theta$  レンズに入射されると、 $f\theta$  レンズから出射される感光ドラムを走査する光ビームの間で走査方向の位置ずれが生じることによって記録紙に印画される画像に色ずれが発生する。本発明は前記事情に鑑み案出されたものであって、本発明の目的は、各半導体レーザの温度差に起因する光ビームの走査方向の位置ずれを防止することができるマルチビーム光源走査装置を提供することにある。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、ハウジングと、前記ハウジング内に配設され光ビームを出射する複数の半導体レーザと、前記ハウジング内に配設され前記各半導体レーザから導かれた前記各光ビームをそれぞれ複数の被照射対象物に向けて走査する走査機構とを備え、前記各半導体レーザはそれぞれ発光体とこれら発光体を個別に収容する複数のケースとを備えるマルチビーム光源走査装置において、前記複数のケースをハウジング上で保持する半導体レーザ保持部が設けられ、前記半導体レーザ保持部は、前記複数の半導体レーザのケースが半導体レーザ保持部を介して相互に熱伝導される状態で各ケースを保持していることを特徴とする。そのため、各半導体レーザの発光部から発生し各ケースに伝導された熱は半導体レーザ保持部を介して相互に伝導されるため、半導体レーザ保持部によって保持されている各半導体レーザの発光体はほぼ同一の温度に保持される。これにより、各半導体レーザの温度差が防止され各半導体レーザから出射される各光ビームは互いの波長が同一となるため、走査機構によって走査される各光ビームの間で互いの波長が異なることに起因する主走査方向の位置ずれの防止が可能となる。

## 【0006】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、本実施の形態では、マルチビーム光源走査装置がカラープリンタに適用された場合について説明する。図1は本発明の実施の形態のマルチビーム光源走査装置の構成を示す平面図、図2は図1をAA線断面から見た状態を示す説明図、図3は光源部の構成を示す平面図、図4は図3を矢印B方向から見た状態を示す説明図、図5は図3を矢印C方向から見た状態を示す説明図である。

【0007】マルチビーム光源走査装置1000は、筐体1の底壁10と、この底壁10の上面10Aに配設さ

れた各部、すなわち光源部100、シリンドレンズ部2010、ポリゴンミラー部300、第1  $f\theta$  レンズ400、第2  $f\theta$  レンズ500、第3  $f\theta$  レンズ600、ミラー部700、水平同期用検知部800などから構成されている。第1  $f\theta$  レンズ400、第2  $f\theta$  レンズ500、第3  $f\theta$  レンズ600、ミラー部700は、特許請求の範囲の光学系に相当している。

【0008】図2に示されているように、底壁10は、水平方向に延在し、その下方には底壁10の下面10Bと間隔をおいて、4個の感光ドラム20A、20B、20C、20D（特許請求の範囲の被照射対象物に相当）が互いに間隔をおいて軸線が平行をなした状態で回転可能に設けられている。各感光ドラム20A、20B、20C、20Dは、カラー画像を形成するために必要な互いに異なる色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）に対応して設けられており、これらイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナーを記録紙に転写するよう構成されている。

【0009】マルチビーム光源走査装置1000の概略動作は以下の通りである。すなわち、光源部100からシリンドレンズ200を通過した4本の光ビームLは、ポリゴンミラー部300によって主走査方向に走査される。走査された各光ビームLは、第1  $f\theta$  レンズ400、第2  $f\theta$  レンズ500、ミラー部700、第3  $f\theta$  レンズ600を介して各感光ドラム20A、20B、20C、20D上に収束されて主走査方向に走査されるよう構成されている。ポリゴンミラー部300によって走査された各光ビームLは、水平同期用検知部800に導かれ、この水平同期用検知部800の検知動作に基いて主走査方向の書き込みタイミングの同期が取られる。なお、各光ビームLの主走査方向は、各感光ドラム20A、20B、20C、20Dの長さ方向に沿っており、この主走査方向と直交する走査方向が副走査方向となる。

【0010】次に各部の構成について詳細に説明する。図3、図4、図5に示されているように、光源部100は、ハウジング110、4個の半導体レーザ120A乃至120D、4個のコリメータレンズ部130A乃至130D、2個のプリズム150A、150B、半導体レーザ保持部170、図略の半導体レーザ駆動回路などを備えて構成されている。

【0011】半導体レーザ120A乃至120Dは、光ビームを出射する図略の発光体と、この発光体を収容する円筒状のケース122と、ケース122の外周面の下部から外方に膨出されたフランジ部124と、ケース122の底部126から延出されたリード線128とを備えている。ケース122の底部126と反対側の上部125には図略の窓部が設けられており、この窓部を介して発光体からの光ビームが出射されるようになっている。また、半導体レーザ120A乃至120Dは、同一

温度ではそれぞれが出力する光ビームの波長が同一となるように構成されている。

【0012】ハウジング110は、底壁10の上面10Aに取着された矩形板状のベース112と、ベース112の側縁部から立ち上げられた縦壁114と、ベース112の縦壁114と反対側の箇所に設けられたブロック状の台座116と、縦壁114の台座116に臨む箇所に設けられたレンズ保持部118と、縦壁114に設けられた半導体レーザ保持部170とを備えている。そして、上述したベース112、縦壁114、半導体レーザ保持部170は、熱伝導率の良好な素材、例えば金属から形成された単一の部材によって構成されている。

【0013】半導体レーザ保持部170は、縦壁114と、この縦壁114に設けられた収容孔部114A乃至114Dとによって構成されている。すなわち、縦壁114には、各半導体レーザ120A乃至120Dを収容する収容孔部114A乃至114Dが縦壁114の厚さ方向に貫通して設けられている。収容孔部114A乃至114Dは、軸線方向に沿って延在する小径部114A1乃至114D1と、段部115を介してこれら小径部114A1乃至114D1に接続された大径部114A2乃至114D2とから構成されている。また、小径部114A1乃至114D1は各フランジ部124が挿入可能な内径となるように構成され、大径部114A2乃至114D2は各ケース122の外周面が挿入可能となるように構成されている。そして、各半導体レーザ120A乃至120Dは、上部125を前方にして各収容孔部114A乃至114Dに挿入され、次述する取付板160と基板部121によってハウジング124が段部115に当て付けられた状態で、すなわちハウジング124と段部115が密接した状態で固定されるようになっている。つまり、上記構成によれば、半導体レーザ保持部170は、各半導体レーザ120A乃至120Dのケース122が半導体レーザ保持部170を介して相互に熱伝導される状態で各ケース122を保持するように構成されている。

【0014】取付板160は、縦壁114の外側面114Eに着脱可能に設けられており、各半導体レーザ120A乃至120Dのリード線128が貫通される貫通孔が形成されている。そして、取付板160は、上記貫通孔に各半導体レーザ120A乃至120Dのリード線128が貫通された状態で縦壁114の外側面114Eに取り付けられている。この取付板160の縦壁114と反対側には、基板部121が保持されており、この基板部121は、各半導体レーザ120A乃至120Dのリード線128と接続され、図略の半導体レーザ回路から供給される駆動信号が各半導体レーザ120A乃至120Dに供給されるようになっている。各半導体レーザ120A乃至120Dは、リード線128が上記基板部121に接続されることで基板部121に固定されてい

る。この基板部121を保持する取付板160が縦壁114の外側面114Eに取り付けられることで、各ハウジング124が段部115に当て付けられるように構成されている。そして、半導体レーザ120A乃至120Dは、各収容孔部114A乃至114Dに収容され各ハウジング124が段部115に当て付けられることで、各光ビームLの光軸が縦壁114と直交し、かつ、互いに平行となるように保持されている。

【0015】各半導体レーザ120A乃至120Dの前方には、各半導体レーザ120A乃至120Dに対応してレンズ保持部118が設けられている。各レンズ保持部118は、縦壁114およびベース112と一体的に形成され、コリメータレンズ部130A乃至130Dを各半導体レーザ120A乃至120Dに対応した位置に保持している。各コリメータレンズ部130A乃至130Dは、各半導体レーザ120A乃至120Dから出射される光ビームLを平行光にするためのコリメータレンズ130A1乃至130D1と、コリメータレンズ130A1乃至130D1を収容する鏡筒130A2乃至130D2と、これらの前方に設けられたスリット130A3乃至130D3とを有している。レンズ保持部118は、各コリメータレンズ130A1乃至130D1と各スリット130A3乃至130D3のそれぞれの光軸が光ビームLの光軸と一致するように鏡筒130A2乃至130D2を保持するように構成されている。鏡筒130A2乃至130D2は、レンズ保持部118に保持された状態で、各コリメータレンズ130A1乃至130D1をその光軸方向に移動可能に保持しており、コリメータレンズ130A1乃至130D1の焦点調整ができるように構成されている。

【0016】図5に示されているように、コリメータレンズ130A1、130D1はそれぞれの光軸が平面からみて一致し、鉛直方向に間隔をおいて平行をなすように位置している。コリメータレンズ130B1、130C1はそれぞれの光軸が平面からみてコリメータレンズ130A1、130D1の光軸を挟み、かつ、鉛直方向に間隔をおいて位置している。そして、コリメータレンズ130A1、130B1の光軸の鉛直方向の間隔と、コリメータレンズ130B1、130C1の鉛直方向の光軸の間隔と、コリメータレンズ130C1、130D1の鉛直方向の光軸の間隔とは同じ距離tとなるように構成されている。

【0017】プリズム150Aは台座116の上部に取着され、このプリズム150Aの上部にプリズム150Bが取着されている。プリズム150Aは、コリメータレンズ130B1の光軸を反射面150A1、150A2によって水平方向に90度ずつ反射させることによって、コリメータレンズ130B1の光軸をコリメータレンズ130A1、130D1の光軸と平面から見て一致するようにするものである。また、プリズム150B

は、コリメータレンズ130C1の光軸を反射面150B1、150B2によって水平方向に90度ずつ反射されることによって、コリメータレンズ130C1の光軸をコリメータレンズ130A1、130D1の光軸と平面から見て一致するようにするものである。したがって、各コリメータレンズ130A1乃至130D1の光軸は、平面から見て一致し、各光軸は等間隔（距離t）において平行をなすように構成されている。このため、各コリメータレンズ130A1乃至130D1を通過した各半導体レーザ120A乃至120Dの光ビームLも上記と同様に平面から見て一致し、各光軸は等間隔（本例では距離t）において平行をなして光源部100から出射されるようになっている。

【0018】図1に示されているように、シリンドレンズ部200は、壁部10の上面10Aに取着されたベース210と、このベース部210から立設されたレンズ保持部220と、レンズ保持部220によって保持されたシリンドレンズ230とを有している。シリンドレンズ230は、光源部100から出射された各光ビームLを入射する入射面230Aと、入射した各光ビームLを出射する出射面230Bとを有している。入射面230Aは各光ビームLと直交する平面をなしている。一方、出射面230Bは水平方向に延在する軸線を有する円筒の外周面が4個鉛直方向に並べられた形状をなしている。上記各軸線は鉛直方向に等間隔（本例では距離t）において互いに平行をなしている。したがって、鉛直方向に等間隔（距離t）で並んで入射面230Aに入射された各光ビームLは、出射面230Bを構成する各円筒の外周面の部分からそれぞれ鉛直方向に等間隔（距離t）を有した状態で出射されるようになっている。このため、各コリメータレンズ130A1乃至130D1によって平行光となった各光ビームLは、シリンドレンズ230を通過することで水平方向（主走査方向）は収束されず、鉛直方向（副走査方向）にのみ収束されることになる。そして、シリンドレンズ230の焦点位置、すなわち各光ビームLが最も収束されて水平方向に延在する線像となる位置は、後述するポリゴンミラー320の反射面322の位置となるように設定されている。

【0019】ポリゴンミラー部300は、底部10の上面10Aに取着されたモータ部310と、モータ部310の鉛直方向に向けられた回転軸312に取着されたポリゴンミラー320とを有している。ポリゴンミラー320は、平面から見て6個の反射面322が正六角形をなすように設けられており、各反射面322は水平面に対して直交している。そして、各反射面322はそれぞれ単一の面を形成しており、この単一の面にシリンドレンズ230から出射された各光ビームLが入射するようになっている。図1において、モータ部310は、図略のモータ制御回路から入力される駆動信号によって等速で反時計回転の方向に高速回転されるようになってお

り、これにより、各光ビームLは、紙面右方から左方に向かう主走査方向に走査される。

【0020】第1fθレンズ400は、後述する第2、第3fθレンズ500、600、ミラー部700と共にfθレンズ部を構成しており、このfθレンズ部はポリゴンミラー320によって主走査方向に走査される各光ビームLを各感光ドーム20A乃至20D上に収束させる作用を果たす。第1fθレンズ400は、ポリゴンミラー320によって走査された各光ビームLを入射するように構成されており、底壁10の上面10Aに図略の保持部材を介して取着されている。第1fθレンズ400は、単一の素材からなる単一の部材として構成されている。第1fθレンズ400は、半導体レーザ120A乃至120Dの各光ビームLが入射される入射面410と、入射面410に入射された各光ビームLがそれぞれ出射される出射面420を有している。出射面420は、各光ビームLに対応して4つの光軸を有した形状を呈しており、上記各光軸が鉛直方向に等間隔（本例では距離t）において互いに平行をなすように構成されている。したがって、鉛直方向に等間隔（距離t）で並んで入射面410に入射された各光ビームLは、出射面420からそれぞれ鉛直方向に等間隔（距離t）を有した状態で出射されるようになっている。第1fθレンズ400は、各光ビームLを主として鉛直方向（副走査方向）に収束させる作用を有し、水平方向（主走査方向）に収束させる作用も有している。ここで、第1fθレンズ400による光ビームLを水平方向に収束させる作用は、鉛直方向に光ビームLを収束させる作用よりも弱くなるように構成されている。

【0021】第2fθレンズ500は、第1fθレンズ400から出射された光ビームLが入射される入射面500Aと、この入射面500Aに入射された光ビームLが出射される出射面500Bとを有し、底壁10の上面10Aに図略の保持部材を介して取着されている。第2fθレンズ500は、単一の素材からなる単一の部材で構成されており、各光ビームLの全てがこの単一の部材を通過するようになっている。第2fθレンズ500は、各光ビームLを水平方向（主走査方向）にのみ収束させ、鉛直方向（副走査方向）には収束させない作用を有している。

【0022】ミラー部700は、第2fθレンズ500から出射された各光ビームLを次述する第3fθレンズ600を構成するfθレンズ600A乃至600Dに導くように構成されている。ミラー部700は、第1乃至第4ミラーパーク710、720、730、740から構成されている。第1ミラーパーク710は、半導体レーザ120Aの光ビームLを600Aに導く1個のミラー712から構成されている。第2ミラーパーク720は、半導体レーザ120Bの光ビームLをfθレンズ600Bに導く2個のミラー722、724から構成されている。第3

ミラー群730は、半導体レーザ120Cの光ビームLをfθレンズ600Cに導く3個のミラー732、734、736から構成されている。第4ミラー群740は、半導体レーザ120Dの光ビームLをfθレンズ600Dに導く3個のミラー742、744、746から構成されている。これら各ミラー712、722、724、732、734、736、742、744、746はそれぞれ光ビームLの主走査方向にわたって延在して設けられており、図略の保持部材を介して底壁10の上面10Aに取着されている。

【0023】第3fθレンズ600は、各光ビームLにそれぞれに対応して個別に設けられたfθレンズ600A乃至600Dと、これらfθレンズ600A乃至600Dをそれぞれ底壁10の上面10Aに取着する保持部材610A乃至610Dとを有している。第3fθレンズ600のfθレンズ600A乃至600Dは、各光ビームLを主に副走査方向に収束させる作用を有し、水平方向（主走査方向）に収束させる作用も有している。ここで、各fθレンズ600A乃至600Dによる光ビームLを収束させる作用は、鉛直方向に光ビームLを収束させる作用よりも弱くなるように構成されている。

【0024】一方、底壁10には、各感光ドラム20A乃至20Dの上部に臨む箇所に、各感光ドラム20A乃至20Dの軸線と平行に、すなわち光ビームLの主走査方向にわたって延在する開口12A乃至12Dが貫通して設けられている。この開口12A乃至12Dの上面10A側の周縁部には保持部材610A乃至610Dが取着され、これら保持部材610A乃至610Dによってfθレンズ600A乃至600Dが保持されている。すなわち、fθレンズ600A乃至600Dは各光ビームLのそれぞれに対応した個別の箇所で光ビームLの主走査方向にわたって延在している。そして、fθレンズ600A乃至600Dは、それぞれ光ビームしが入射される入射面600A1乃至600D1と、これら入射面600A1乃至600D1に入射された各光ビームしが出射される出射面600A2乃至600D2とを有している。

【0025】ここで、第1乃至第4ミラー群710、720、730、740と各fθレンズ600A乃至600Dとの配置関係について説明する。第1ミラー群710のミラー712は、第2fθレンズ500から水平方向に出射された光ビームLを90度下方に反射させて、fθレンズ600Aの入射面600A1に対して直交して入射させるように構成されている。第2ミラー群720のミラー722は、第2fθレンズ500から水平方向に出射された光ビームLを45度上方に反射させてミラー724に導き、このミラー724はそれに入射された光ビームLを45度下方に反射させて、fθレンズ600Bの入射面600B1に対して直交して入射させるように構成されている。第3ミラー群730のミラー7

32は、第2fθレンズ500から水平方向に出射された光ビームLを下方に反射させてミラー734に導き、このミラー734はそれに入射された光ビームLを上方に反射させてミラー736に導き、このミラー736はそれに入射された光ビームLを下方に反射させてfθレンズ600Cの入射面600C1に直交して入射させるように構成されている。第4ミラー群740のミラー742は、第2fθレンズ500から水平方向に出射された光ビームLを90度上方に反射させてミラー744に導き、このミラー734はそれに入射された光ビームLを90度に反射させてミラー736に導き、このミラー736はそれに入射された光ビームLを90度下方に反射させてfθレンズ600Dの入射面600D1に対して直交して入射させるように構成されている。

【0026】第1、第3fθレンズ400、600の作用により各光ビームLを主に副走査方向に収束させ、第2fθレンズ500の作用により各光ビームLを主走査方向に収束させている。この結果、ポリゴンミラー220の反射面222の位置で水平方向に延在する線像となった各光ビームLは、この反射面222によって反射された後、上記第1乃至第3fθレンズ400、500、600の作用によって各感光ドラム20A乃至20Dの面の位置で主走査方向および副走査方向の両方向に収束され点像となるようになっている。

【0027】水平同期検知部800は、ミラー810と、受光センサ820とを有して構成されている。ミラー810は、感光ドラムのビーム主走査方向において、画像形成に寄与する走査範囲から外れた手前の所定位置に配設され、この所定位置に到達した光ビームLを受光センサ820へ反射させるように底壁10の上面10Aに取付部材812によって取着されている。受光センサ820は、第2fθレンズ500を通過する光ビームLのうちミラー810によって導かれた画像形成に寄与しない走査範囲の光ビームLを入射するように底壁10の上面10Aに取付部材822によって取着されている。受光センサ820から出力される受光信号に基いて各半導体レーザ120A乃至120Dの駆動信号を制御することで感光ドラム20A乃至20Dに対する主走査方向への書き込み動作の同期が取られるようになっている。

【0028】次に、上述のように構成されたマルチビーム光源走査装置1000の作用効果について説明する。発光部100の半導体レーザ120A乃至120Dから出射された各光ビームLは、鉛直方向に間隔をおいて平行をなした状態でシリンドレンズ230に入射して副走査方向（鉛直方向）にのみ収束され、モータ部310によって高速回転しているポリゴンミラー320の各反射面322に到達する。

【0029】ポリゴンミラー320が高速回転することで各反射面322によって反射されて走査された各光ビームLは、第1fθレンズ400に入射される。各光ビ

11

ームしは第1  $f\theta$  レンズ400の作用によって主に鉛直方向（副走査方向）に収束されて第2  $f\theta$  レンズ500に入射される。各光ビームLは、単一の素材から形成された単一の部材から構成された第2  $f\theta$  レンズ500の作用によってそれぞれ水平方向（主走査方向）にのみ収束されて出射される。

【0030】そして、各光ビームLのうち、半導体レーザ120Aから出射された光ビームLは、第1ミラー群710によって第3  $f\theta$  レンズ600Aに導かれ主に副走査方向に収束されてイエローに対応する感光ドラム20A上に点像として収束された状態で主走査方向に走査される。半導体レーザ120Bから出射された光ビームLは、第2ミラー群720によって第3  $f\theta$  レンズ600Bに導かれ主に副走査方向に収束されてマゼンタに対応する感光ドラム20B上に点像として収束された状態で主走査方向に走査される。半導体レーザ120Cから出射された光ビームLは、第3ミラー群730によって第3  $f\theta$  レンズ600Cに導かれ主に副走査方向に収束されてシアンに対応する感光ドラム20C上に点像として収束された状態で主走査方向に走査される。半導体レーザ120Dから出射された光ビームLは、第4ミラー群740によって第3  $f\theta$  レンズ600Dに導かれ主に副走査方向に収束されてブラックに対応する感光ドラム20D上に点像として収束された状態で主走査方向に走査される。

【0031】また、第2  $f\theta$  レンズ500を通過する光ビームLのうち画像形成に寄与しない走査範囲の光ビームLは、ミラー810によって受光センサ820に導かれ、この受光センサ820から出力される受光信号に基いて各半導体レーザ120A乃至120Dの駆動信号が制御されることで、感光ドラム20A乃至20Dに対する主走査方向への書き込み動作の水平方向の同期が取られる。

【0032】そして、光源部100の各半導体レーザ120A乃至120Dがそれぞれ異なるタイミングで異なる時間駆動された場合、各半導体レーザ120A乃至120Dの発光部から発生した熱は、各ケース122から各フランジ部124を介して各収容孔部114A乃至114Dの各段部115に伝導される。各段部115に伝導された熱は、縦壁114に伝導されるが、この縦壁114は熱伝導率の良好な素材から形成された単一の部材によって構成されているため、縦壁114の全体に伝導される。このため、縦壁114はほぼ一様の温度となり、縦壁114の温度は、各収容孔部114A乃至114Dの各段部115から各半導体レーザ120A乃至120Dの各ケース122に伝導され、この結果、各半導体レーザ120A乃至120Dの発光部はほぼ同一の温度に保持される。これは、半導体レーザ保持部170が、各半導体レーザ120A乃至120Dのケース122が半導体レーザ保持部170を介して相互に熱伝導さ

12

れる状態で各ケース122を保持するように構成されていることによるものである。

【0033】したがって、各半導体レーザ114A乃至114Dにおける温度差が防止されるので、各光ビームLを主走査方向に収束する第2  $f\theta$  レンズ500に入射される各半導体レーザ114A乃至114Dからの各光ビームLは互いの波長が同一となり、第2  $f\theta$  レンズ500から出射される光ビームLの間で走査方向の位置ずれが生じることを防止することができる。この結果、従来と違って、各感光ドラム上を走査する光ビームL間で主走査方向の位置ずれが発生せず、各感光ドラムによって記録紙に印画される画像に色ずれが発生することを防止できる。

【0034】なお、本実施の形態では、光源部100に4つの半導体レーザ120A乃至120Dを設け、4色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）に対応した4つの光ビームLを出射させ、第1、第3  $f\theta$  レンズ400、500によって4つの光ビームLをそれぞれ副走査方向に収束させる構成としたが、本発明は光源と光ビームLの個数が4つである構成に限定されるものではない。例えば、3つの光源のそれぞれによってイエロー、マゼンタ、シアンの3色に対応した3つの光ビームLを出射させ、第1、第3  $f\theta$  レンズ400、500によって3つの光ビームLをそれぞれ副走査方向に収束させる構成とすることもできることはもちろんである。

【0035】

【発明の効果】以上の説明で明らかなように本発明は、ハウジングと、複数の半導体レーザと、各半導体レーザから導かれた各光ビームをそれぞれ複数の被照射対象物に向けて走査する走査機構とを備え、各半導体レーザはそれぞれ発光部とこれら発光部を個別に収容する複数のケースとを備えるマルチビーム光源走査装置において、複数のケースをハウジング上で保持する半導体レーザ保持部が設けられ、半導体レーザ保持部は、複数の半導体レーザのケースが半導体レーザ保持部を介して相互に熱伝導される状態で各ケースを保持していることを特徴とする。そのため、各半導体レーザの発光部から発生し各ケースに伝導された熱は半導体レーザ保持部を介して相互に伝導されるため、半導体レーザ保持部によって保持されている各半導体レーザの発光部はほぼ同一の温度に保持される。これにより、各半導体レーザの温度差が防止され各半導体レーザから出射される各光ビームは互いの波長が同一となるため、走査機構によって走査される各光ビームの間で互いの波長が異なることに起因する主走査方向の位置ずれの防止が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態のマルチビーム光源走査装置の構成を示す平面図である。

【図2】図1をAA線断面から見た状態を示す説明図で50ある。

13

14

【図3】光源部の構成を示す平面図である。

【図4】図3を矢印B方向から見た状態を示す説明図である。

【図5】図3を矢印C方向から見た状態を示す説明図である。

【符号の説明】

L 光ビーム

20A乃至20D 感光ドラム

100 光源部

110 ハウジング

114 縦壁

114A乃至114D 収容孔部

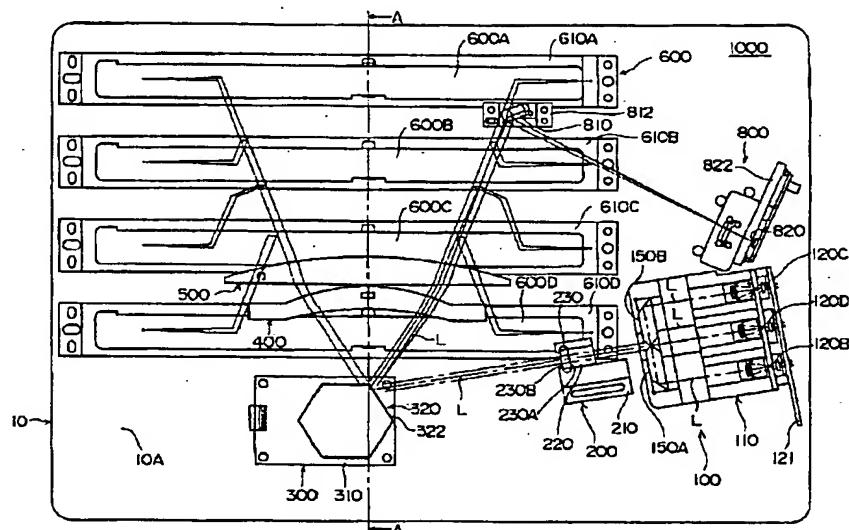
120A乃至120D 半導体レーザ

122 ケース

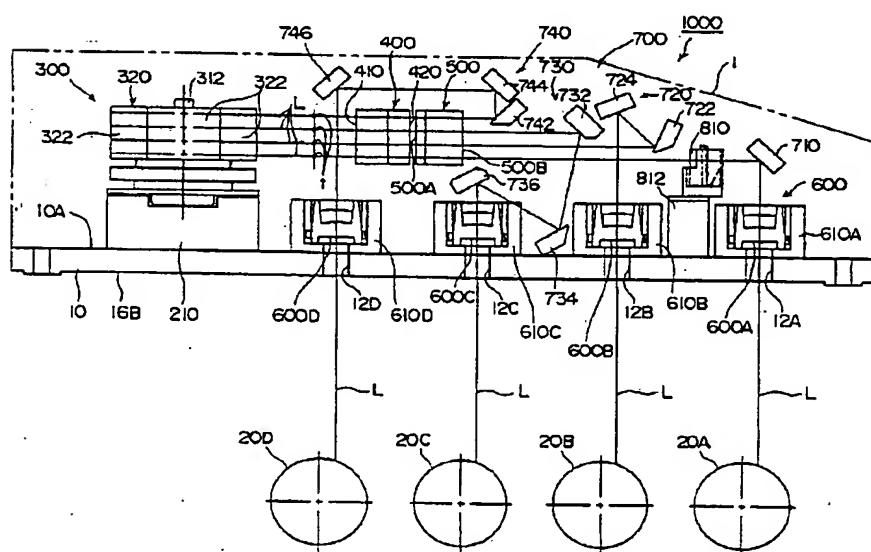
170 半導体レーザ保持部

1000 マルチビーム光源走査装置

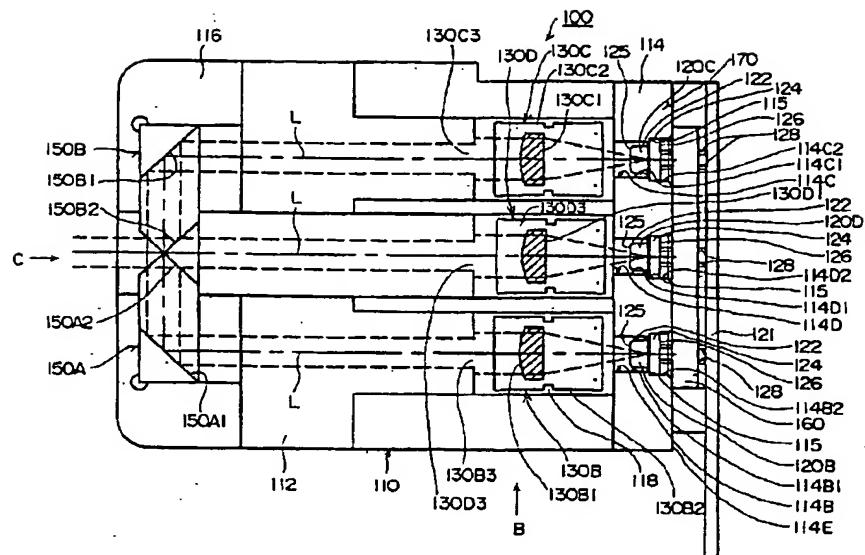
【図1】



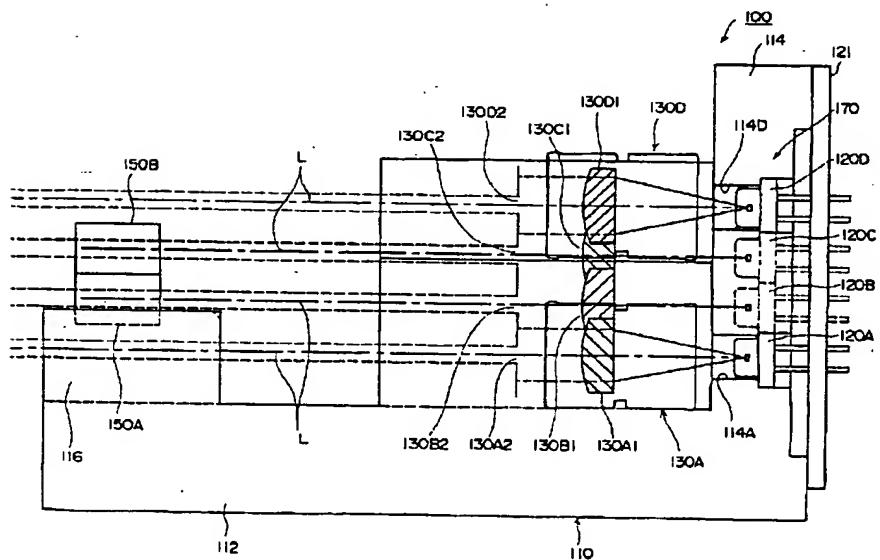
【図2】



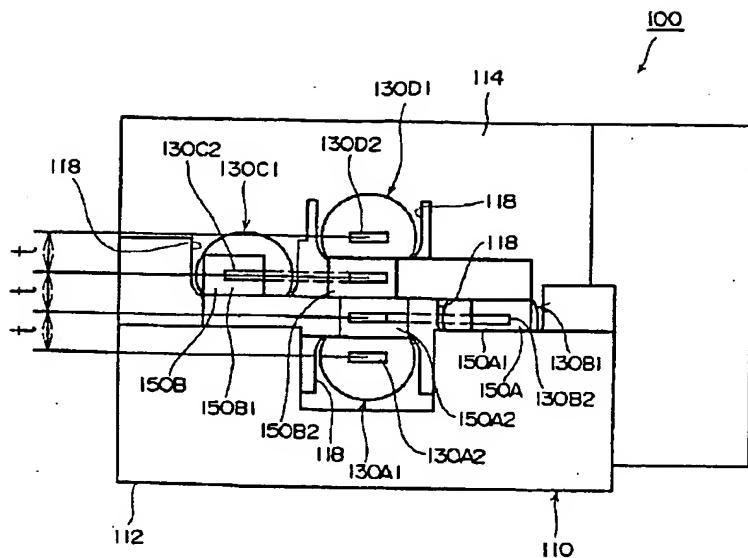
【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72) 発明者 三ヶ尻 晋

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工業株式会社内

F ターム(参考) 2C362 AA09 AA43 AA44 AA46 AA60  
BA51 BA52 BA86 CA22 CA39  
DA33  
2H045 AA01 AA52 BA24 CA63 CA82  
CA98 DA02 DA04